

FIB-SEM (XVision200DB) 単価表

2026年 4月1日

装置番号	装置	設置場所	装置分類	機器利用	単位	技術代行	単位
FIB-01	FIB-SEM (エスアイアイ・ナノテクノロジー XVision200DB)	つくばセンター 2-1A棟2階234室	微細加工・ デバイス試作	200,000	(円/日)	300,000	(円/日)
FIB-02	イオンコーター (日立ハイテク E-1030)	つくばセンター 2-1A棟2階234室	微細加工・ デバイス試作	10,000	(円/回)		

装置番号：装置管理のために使用している番号

設置場所：装置が設置してある場所

装置区分：装置の利用目的や原理に応じて分類された区分

※この単価表に記載した金額は消費税を含みます。

※技術指導は実施していません。